

四槽円鏡型浮遊帯域溶融装置

型式 : FZ-T-10000-H-VII-VPM-MII-PC



Crystal Systems Corp.
株式会社クリスタルシステム

〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町 9633 番地 1
TEL 0551-36-5271 FAX:0551-36-5273
<http://www.crystalsys.co.jp> e-mail: eigy@crystalsys.co.jp

仕様の概要 (詳細は弊社担当者にお問い合わせください)

型式	FZ-T-10000-H-VII-VPM-MII-PC		
使用ランプ種類	ハロゲン		
使用ランプ、ミラー個数	4 個		
雰囲気制御圧力	最高到達圧力	9.5 atm (0.95MPa)	
	最高到達真空度	5×10^{-5} Torr (6.7×10^{-3} Pa)	
シャフトシール方式	磁性流体		
最高到達温度 ()	2,200		
常用使用温度 ()	1,850		
標準具備ランプ (各ランプは 4 本一組、各 2 組を標準装備、)	300W		
	1,000W		
	1500W		
円周方向温度差	30 以下		
出力電圧変動	入力変動 $\pm 10\%$ に対して $\pm 0.2\%$ 以下		
用力	電力	三相 200V, 40A	
	冷却水	3L/min	
寸法 (mm)	装置	本体	コントロールボックス
	幅	900	600
	奥行	900	760
	高さ	約 2855	約 1700 (Gas Box 含む)

注．上記仕様は断り無く変更することがあります。 随時、営業担当者にお問い合わせ下さい。